2016/1/30望遠鏡および観測装置会議@キャンパスプラザ京都

極限補償光学装置の進捗

山本広大(大阪大学/京都大学)

1.SEICAのAO
 2.AO後のイメージ
 3.円盤観測のイメージ
 4.実機組み立て
 5.制御試験













<u>SEICA補償光学</u>

<mark>傾斜</mark>計測: T/T+Woofer 低速、粗い波面制御

<mark>位相</mark>計測: Tweeter 高速、高精度波面制御







3.8望遠鏡による像(単純なパワースペクトル時) 平面波入射時 無補正大気乱流入射時 補償光学後



表示レンジ[0:1e-5]











武藤(工学院大学)さんの 円盤モデル

距離:140pc 円盤内縁: 1AU サイズ: 284x284pix スケール: 10mas/pix 単位: Jy/pixel

(142,142)に中心星

中心星強度: 0.235/pix 円盤内縁: 1.964x10⁻⁵/pix 武藤さんの円盤像に対して、円形開口の回折限界像、SR80%, 50%, 30%, Seeing 1", 2"の 時のPSFをコンボリューションした結果



回折限界





SR80%





SR50%



Seeing 1"

Seeing 2"



4.55e-09 7.49e-09 1.05e-08 1.34e-08 1.64e-08 1.93e-08 2.23e-08 2.52e-08 2.82e-08

武藤さんの円盤像に対して、円形開口の回折限界像、SR80%, 50%, 30%, Seeing 1", 2"の時のPSFをコンボリューションした結果



回折限界





SR80%





SR50%



Seeing 1"

Seeing 2"



• PSF差し引きで円盤の検出が出来るか。



回折限界

SR30%

Seeing 1"

無補正(Seeing 1")では円盤検出は出来ないが、SR30%程度でも円盤形状が 推測できる。 ※AOのモデル化を反映できていない。 ノイズなどは未評価。今後おこなう。

AO光学系の組み立て、評価



 光軸調整用ピンホール (機械位置精度で決めて基準とする)

 干渉計の光を入射

 反り光を干渉計で波面計測

 火軸調整用瞳代替平面鏡 (機械位置精度で決めて基準とする)

 要求精度 位置精度: 100um 角度精度: 1分角 波面精度: λ/4

放物面鏡調整基準 x軸: ピンホール位置(±75um) y軸: ピンホール位置(±75um) z軸(光軸): focus収差 x軸回転: 0度非点収差 y軸回転: 45度非点収差



要求精度 位置精度: 100um 角度精度: 1分角 波面精度: λ/4

調整結果

放物面鏡調整基準

x軸:ピンホール位置(±75um) y軸:ピンホール位置(±75um) z軸(光軸):focus収差 x軸回転:0度非点収差 y軸回転:45度非点収差

干渉計測定波面でλ/3 (P-V)で設置完了。 →放物面鏡ではλ/6の精度を達成。





 \rightarrow Tweeter(OAP5)

SEICA補償光学の課題/問題点

- SEICA AOの組み立て
 - 組み立て手順はほぼ確立
 - OAP2-5の製作, Unit(治具)の製作
- SEICA AOの制御:
 - WFSの平面出し(ゼロ点)
- SEICA構体: チャンバー, 除振台, 恒温槽(常圧20℃±0.05℃)
- ADC (大気分散補正光学系)
- Img rotator (SEICA用)
- PDI (中川君発表)の開発
- 要検討課題: 望遠鏡由来のエラーを評価
- 1. 分割鏡の制御誤差
 - DMでは取れない局所成分で、低空間周波数のパターンを形成するので、主星近傍にスペックルを 形成してしまう。
 - 適切なLyot Stopの製作、設置が必要。
- 2. 鏡の製作誤差(高周波、静的)
 - 差し渡し12分割のDMでは取り切れない誤差がある。
 - この誤差で2-3桁のコントラストに制限されてしまう。
 - 完成した分割鏡の実測値でエラーを見積もる。
- 3. 鏡の支持構造とwarping harness(低周波、動的)
 - 低空感周波数側でエラーをうむ。DMで除去できるか。